

MPI TS3000-SIPH | IceFreeEnvironment™付300 mmオート・プローバー

シリコンフォトニクスデバイス特性評価用プローバー

顕微鏡および顕微鏡オプション

- 堅牢なプログラマブル顕微鏡ブリッジ・マウント (50 x 50 x 140 mm)
- さまざまな顕微鏡より選定可能(光学ズーム最大12倍までのMPI AMZ12単眼鏡筒、iMAG®デジタル顕微鏡など)
- 高倍率顕微鏡 FS70/PSM-1000

マルチチャンネル フォトニクス測定機能

- さまざまなデバイスの仕様にあわせてダイヤル型または単一入力のセットアップが可能
- 追加でDC/RFポジションの設置が可能
- 光プローブ・アーム(デバイス毎のファイバー・ホルダ付)、距離センサ組み込み

プローブ・プラテン

- 高剛性、安定設計
- RFポジション用角型調整器
- エアークーリング機構内蔵のすぐれた熱安定性 設計

IceFreeEnvironment™

- 広温度範囲(低温でも)ポジション、プローブ・カードの使用を可能に
- 同軸/トライアキシャル、広温度範囲の温度チャック対応可能(下限温度-60℃から上限温度300℃まで)
- フィールドにてアップグレード可能

一体型防振台

- 高性能防振機構
- 作業効率を最大限に引き出す高さ設計



シリコンフォトニクス測定用設置アクセサリ

- 制御用ハードウェア設置用計測器トレイ
- 光学デバイス出力測定用光度計
- その他ご要望によりカスタマイズ可能

プローバー制御ソフトウェアSENTIO®

- 簡単で直感的な操作、画期的なマルチ・タッチ式コントロールによりトレーニング時間を大幅に削減
- スクロール、ズーム、ムーブコマンドはスマートフォンの操作と似ているためでもすぐに操作が可能
- 現在使用中のアプリケーションから他のアプリケーションへの移動は指をスワイプするだけで可能
- RF校正用ソフトウェアQAibria®はSENTIO®と完全統合されており、同じコンセプトのもとに設計されているため、非常に簡単に使いこなすことが可能
- リモート制御用GPIB, TCP/IPインタフェース

RFキャリブレーション

- 校正基板/コンタクト基板用2つの補助チャック
- THz周波数帯域までの測定を実現するセラミック材質
- 平坦度1 μm (高コンタクト精度)

温度チャックインテグレーション

- チャックも組み込まれたタッチスクリーンにより制御可能
- 前面タッチスクリーンによる簡単で素早い制御
- チャラーがプローバーに統合された省スペース設計

ハードウェア・コントロール・パネル

- より早く、より安全に、より簡単にプローバーを制御
- キーボードおよびマウスはプローバー、計測器ともに操作可能、操作しやすい位置に

オプション

- 測定器用トレイの設置によりケーブル長を短くし測定をより確実なものに
- 暗箱